

高真空蒸着装置 RD-1200



高真空蒸着装置RD-1200はOLED(有機発光ダイオード)成膜用小型蒸着装置です。排気系はターボ分子ポンプによる排気で、排気操作は全自動です。水晶振動式膜厚計もオプションで付けることができ、卓上型タイプとしては高性能な成膜制御が可能です。

高真空蒸着装置RD-1200仕様

- 到達圧力 $\times 10^{-4}$ Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
- 真空室径 $\phi 230\text{mm} \times 350\text{mmH}$ 硬質ガラス
- 蒸着機構 抵抗加熱方式
AC電源2極(切替式)・・・金属用
DC電源1極・・・有機物用
AC電源・・・12V0～100A/DC電源0～10V 0～35A
- 基板形状 $\phi 210\text{mm}$ 以内ご希望形状
- 真空排気系 油回転ポンプ:50L/min[50Hz]
ターボ分子ポンプ:60L/sec
- 真空計 圧カスイッチ/ピラニ真空計/電離真空計
- 操作方法 排気系自動
- 制御系 ターボ分子ポンプパワーサプライ/デジタル温調計(ポート部测温)
- ユーティリティ電気:AC100V単相15A AC100V単相10A
冷却水:2L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環
寸法:900mmW \times 800mmD \times 680mmH
- オプション 水晶振動式膜厚計他、多数のオプション付加&カスタマイズ可能